

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成23年3月17日(2011.3.17)

【公開番号】特開2008-268880(P2008-268880A)

【公開日】平成20年11月6日(2008.11.6)

【年通号数】公開・登録公報2008-044

【出願番号】特願2008-22362(P2008-22362)

【国際特許分類】

G 0 9 F	9/00	(2006.01)
G 0 9 F	9/30	(2006.01)
H 0 1 L	27/32	(2006.01)
H 0 5 B	33/10	(2006.01)
H 0 5 B	33/04	(2006.01)
H 0 1 L	51/50	(2006.01)

【F I】

G 0 9 F	9/00	3 5 2
G 0 9 F	9/00	3 3 8
G 0 9 F	9/00	3 0 1
G 0 9 F	9/30	3 6 5 Z
H 0 5 B	33/10	
H 0 5 B	33/04	
H 0 5 B	33/14	A

【手続補正書】

【提出日】平成23年1月27日(2011.1.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板の上に順に、第1電極と、有機層と、第2電極と、を含む有機発光素子を形成し、前記第2電極の上に第1封止層を形成する工程と、

前記第1電極と第2電極との短絡部位において、少なくとも前記第1封止層と前記第2電極とをレーザーを照射することにより除去する工程と、

第2封止層を前記除去された部位に形成する工程と、を有することを特徴とする有機発光装置の製造方法。

【請求項2】

絶縁部材を前記除去された部位に充填する工程を有し、

前記第2封止層を形成する工程は、前記絶縁部材の上に形成する工程であることを特徴とする請求項1に記載の有機発光装置の製造方法。

【請求項3】

前記第2電極及び前記第1封止層は、光透過部材であり、

前記除去する工程は、前記第1封止層側から行うことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の有機発光装置の製造方法。

【請求項4】

前記第2封止層を形成する工程は、局所CVD法により行うことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の有機発光装置の製造方法。

**【請求項 5】**

前記絶縁部材を充填する工程は、インクジェット法により行うことを特徴とする請求項2に記載の有機発光装置の製造方法。

**【手続補正 2】**

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正の内容】

**【0001】**

本発明は、ディスプレイ、あるいは光源、照明等に用いられる有機発光素子（有機エレクトロルミネッセンス素子）を有する有機発光装置の製造方法に関するものである。

**【手続補正 3】**

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正の内容】

**【0014】**

そのために本発明の有機発光装置の製造方法は、

基板の上に順に、第1電極と、有機層と、第2電極と、を含む有機発光素子を形成し、前記第2電極の上に第1封止層を形成する工程と、

前記第1電極と第2電極との短絡部位において、少なくとも前記第1封止層と前記第2電極とをレーザーを照射することにより除去する工程と、

第2封止層を前記除去された部位に形成する工程と、  
を有することを特徴とする。